### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-159786

(43)公開日 平成7年(1995)6月23日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G02F	1/1337				•
	1/13	500			
	1/1333	5 0 5			

### 審査請求 未請求 請求項の数21 OL (全 16 頁)

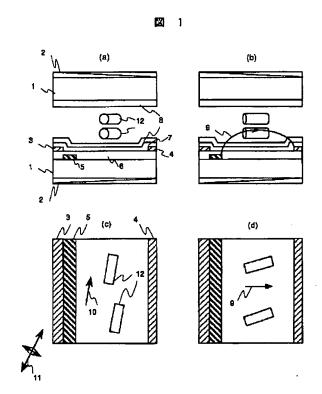
(21)出願番号	特顧平6-222952	(71)出願人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出願日	平成6年(1994)9月19日		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	大江 昌人
(31)優先権主張番号	特顧平5-254028		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
(32)優先日	平 5 (1993)10月12日		式会社日立製作所日立研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	近藤 克己
(31)優先権主張番号	特顧平5-233262		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
(32)優先日	平 5 (1993) 9 月20日		式会社日立製作所日立研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人	<b>弁理士 小川 勝男</b>

### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

#### (57)【要約】

【目的】残像が少ない高表示品質の液晶表示装置を得 る。

【構成】表示画素が、電極により基板上に構成され、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して形成されており、該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、該基板により液晶層が挟持され、該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成され、該電極は、外部の制御手段と接続されており、該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶表示装置であって、図形を30分間表示し、表示部を消去してから、該表示部と非表示部が識別できなくなるまでの時間が5分以内であることを特徴とする液晶表示装置。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】表示画素が、電極により基板上に構成さ れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して 形成されており、

該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、 該基板により液晶層が挟持され、

該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成 され、

該電極は、外部の制御手段と接続されており、

該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶 10 表示装置であって、

図形を30分間表示し、表示部を消去してから、該表示 部と非表示部が識別できなくなるまでの時間が5分以内 であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】表示画素が、電極により基板上に構成さ れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して 形成されており、

該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、 該基板により液晶層が挟持され、

該電極は、外部の制御手段と接続されており、

該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶 表示装置であって、

図形を30分間表示し、表示部を消去してから、該表示 部と非表示部が識別できなくなるまでの時間が5分以内 であり、

該液晶層、該配向膜及び/もしくは該絶縁膜の比誘電率  $\varepsilon_{\rm r}$  と比抵抗  $\rho$  の積 $((\varepsilon_{\rm r}\rho)_{\rm LC}, (\varepsilon_{\rm r}\rho)_{\rm AF}$ 及び/ もしくは  $(\varepsilon_1 \rho)_{1AS}$  が、 $1 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm以上} 8 \times 30$ 10<sup>16</sup> Ω・cm以下であることを特徴とする液晶表示装

【請求項3】表示画素が、電極により基板上に構成さ れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して 形成されており、

該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、 該基板により液晶層が挟持され、

該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成 され、

**飯電極は、外部の制御手段と接続されており、** 

該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶 表示装置であって、

図形を30分間表示し、表示部を消去してから、該表示 部と非表示部が識別できなくなるまでの時間が5分以内 であり、

該配向膜及び/もしくは該絶縁膜の表面抵抗の値が3. 3×10<sup>11</sup>Ω/□ 以上2.5×10<sup>18</sup>Ω/□ 以下であ ることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】表示画素が、電極により基板上に構成さ れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して 形成されており、

該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、 該基板により液晶層が挟持され、

該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成 され、

該電極は、外部の制御手段と接続されており、

該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶 表示装置であって、

該液晶層,該配向膜及び/もしくは該絶縁膜の比誘電率  $\varepsilon$  r と比抵抗 $\rho$ の積(( $\varepsilon$  r $\rho$ )  $\iota$  c, ( $\varepsilon$  r $\rho$ )  $\iota$  r 及び/ もしくは(ειρ)ρΑς)を近似させることを特徴とする 液晶表示装置。

【請求項5】請求項4記載の液晶表示装置において、 該積が1×10°Ω・cm 以上8×10<sup>15</sup>Ω・cm以下であ ることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】表示画素が、電極により基板上に構成さ **該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成 20 れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して** 形成されており、

> 該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、 該基板により液晶層が挟持され、

該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成 され、

該電極は、外部の制御手段と接続されており、

該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶 表示装置であって、

該液晶層、該配向膜及び/もしくは該絶縁膜の比誘電率 ε, と比抵抗ρの積((ε,ρ)ις, (ε,ρ) με及び/ もしくは (ε,ρ) ΡΑς) の最大値と最小値の比が1以上 100以下であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】表示画素が、電極により基板上に構成さ れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して 形成されており、

該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、 該基板により液晶層が挟持され、

該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成 され、

該電極は、外部の制御手段と接続されており、

該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶 表示装置であって、

該液晶層、該配向膜及び/もしくは該絶縁膜の比誘電率  $\varepsilon$ , と比抵抗 $\rho$ の積 $((\varepsilon, \rho)_{LC}, (\varepsilon, \rho)_{AP}$ 及び/ もしくは  $(ε_{I} ρ)_{IAS}$  の間に (1) から (3) の関係 が成立していることを特徴とする液晶表示装置。

 $0.1 \le (\epsilon, \rho)_{LC} / (\epsilon, \rho)_{AF} \le 10$ 

(1)

 $0.1 \le (\epsilon_1 \rho)_{LC} / (\epsilon_1 \rho)_{PAS} \le 10$ 

(2)

 $0.1 \le (\epsilon, \rho)_{AF} / (\epsilon, \rho)_{PAS} \le 10$ 

(3)

【請求項8】表示画素が、走査信号電極, 映像信号電 極、画素電極及びアクティブ素子により基板上に構成さ れていることを特徴とする請求項1から4のいずれかに 記載の液晶表示装置。

【請求項9】表示画素が、電極により基板上に構成さ れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して 形成されており、

該基板は、配向膜を形成した基板と対向して配置され、 該基板により液晶層が挟持され、

該電極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成 10 され、

該電極は、外部の制御手段と接続されており、

該液晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶 表示装置であって、

該基板1上の配向膜と該絶縁膜の厚さを合わせて0.5 ~3 µm としたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項10】絶縁膜の厚さを0.4μm~2μm とし たことを特徴とする請求項9記載の液晶表示装置。

【請求項11】配向膜が有機物であり、絶縁膜が無機物 であることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記 載の液晶表示装置。

【請求項12】配向膜が有機物であり、絶縁膜が無機膜 と有機膜の2層構造であることを特徴とする請求項1か ら4のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項13】配向膜が有機物、絶縁膜が無機物であ り、該有機物で構成される層が該無機物で構成される層 より厚いことを特徴とする請求項1から4のいずれかに 記載の液晶表示装置。

【請求項14】配向膜及び絶縁膜が共に有機物で構成さ れることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載 30 の液晶表示装置。

【請求項15】配向膜の液晶層に接する側の面が平坦で あることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載 の液晶表示装置。

【請求項16】配向膜及び絶縁膜が同一材料からなるこ とを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の液晶 表示装置。

【請求項17】カラーフィルターを基板のいずれか一方 の上に、かつ、該カラーフィルターと液晶層との間に絶 縁膜が介在することを特徴とする請求項1から4のいず れかに記載の液晶表示装置。

【請求項18】カラーフィルター上の段差を平坦化する 機能を有する平坦化膜が有機物であり、該平坦化膜の上 に無機物の膜が形成されていることを特徴とする請求項 1から4のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項19】カラーフィルターを有する基板に構成さ れる配向膜が無機物で構成される層を介していることを 特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示 装置。

査信号電極、映像信号電極、画素電極及びアクティブ素 子を有する基板側に構成され、かつ、該カラーフィルタ ーと液晶層との間に絶縁膜が介在することを特徴とする 請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項21】情報を入力する手段を備え、該情報を演 算あるいは所定の処理を行う手段を有し、処理された該 情報を出力する装置と記憶する装置及び内蔵電源を具備 したことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載 の液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、残像の少ない高画質の 液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示装置においては、液晶層 を駆動する電極は2枚の基板上に形成され、相対向して いる透明電極を用いていた。これは液晶に印加する電界 の方向を基板界面にほぼ垂直な方向とすることで動作す る、ツイステッドネマチック表示方式に代表される表示 方式を採用していることによる。一方、液晶に印加する 20 電界の方向を基板界面にほぼ平行な方向にする方式とし て、櫛歯電極対を用いた方式が、例えば特公昭63-2190 7 号公報、WO91/10936により提案されてい る。この場合、電極は透明である必要は無く、導電性が 髙く不透明な金属電極が用いられる。

【0003】しかしながら、これらの公知技術において は、液晶に印加する電界の方向を基板界面にほぼ平行な 方向にする表示方式(以降、横電界方式と称する)をア クティプマトリクス駆動あるいは単純マトリクス駆動す る際、高画質を得るために必要な液晶材料、配向膜及び 絶縁膜の物性に関しては何ら言及していない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ある特定の文字や図形 を液晶表示装置に表示していると、その文字や図形を消 去しても画面内には画像が焼き付き、その画像がしばら く残る残像と称する表示むらがしばしば発生する。液晶 に印加する電界の方向を基板に垂直な方向とする方式で も横電界方式でも、残像が表示品質を損なうという共通 の問題がある。特に、横電界方式では、液晶に印加する 電界の方向を基板界面にほぼ垂直な方向とする表示方式 に比べ、この残像が非常に発生しやすいという問題があ る。

【0005】本発明の目的は、横電界方式において、残 像の少ない髙表示品質の液晶表示装置を提供することに ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に、本発明者らは以下の発明をした。

【0007】表示画素が、電極により基板上に構成さ 【請求項20】カラーフィルターが、表示画素として走 50 れ、該基板には液晶の配向膜が直接又は絶縁膜を介して

形成されており、該基板は、配向膜を形成した基板と対 向して配置され、該基板により液晶層が挟持され、該電 極は、基板と概略平行な電界を発生するように構成さ れ、該電極は、外部の制御手段と接続されており、該液 晶層の光学特性を変化させる偏光手段を備えた液晶表示 装置(以下、横電界方式の液晶表示装置とする)であっ て、図形を30分間表示し、表示部を消去してから、表 示部と非表示部が識別できなくなるまでの時間が5分以 内であることを特徴とする液晶表示装置を発明した。

【0008】また、表示部と非表示部が識別できなくな 10 るまでの時間は黒表示部の輝度(B(黒))と白表示部 の輝度(B(白))を輝度計でモニターすることによ り、より定量的に測定できる。この際、B(白)/B (黒)が1以上1.5 以下になったときの時間を表示部 と非表示部が識別できなくなるまでの時間とする。

【0009】横電界方式の液晶表示装置において、表示 画素は走査信号電極及び映像信号電極で構成される。さ らに、画素電極及びアクティブ素子を具備することが望 ましい。しかしながら、これに限定されるものではな 61

【0010】ここで、配向膜とは液晶を配向させる機能 を有する膜である。また、絶縁膜とは電気的な絶縁をす る膜であるが、電極を保護する機能も持つことが可能で ある。

【0011】また、本発明者らは、横電界方式の液晶表 示装置において、残像をなくすには、液晶層、配向膜及 び/もしくは絶縁膜の比誘電率ε, と比抵抗ρの積  $((\epsilon, \rho)_{LC}, (\epsilon, \rho)_{AF}$ 及び/もしくは $(\epsilon, \rho)$ PAS) が、1×10<sup>9</sup> Ω·cm以上8×10<sup>15</sup> Ω·cm以下で あればよいことを見出した。 **\*** 30

$$0.1 < (s.0) \cdot 1 < (s.4)$$

 $0.1 \le (\epsilon, \rho) \text{ LC} / (\epsilon, \rho) \text{ AF} \le 10$ 

 $0.1 \le (\epsilon, \rho) \text{ LC} / (\epsilon, \rho) \text{ PAS} \le 10$ 

 $0.1 \le (\epsilon, \rho)_{AF} / (\epsilon, \rho)_{PAS} \le 10$ 

(3)

また、本発明者らは、横電界方式の液晶表示装置におい て、基板上の配向膜と絶縁膜の厚さを合わせて、0.5 ~3 µm としたことを特徴とする液晶表示装置を発明 した。

【0020】本発明の液晶表示装置に、情報を入力する 手段を備え、該情報を演算あるいは所定の処理を行う手 段を有し、処理された該情報を出力する装置と記憶する 装置及び内蔵電源を具備することもできる。

【0021】本発明の液晶表示装置において、絶縁膜の 厚さは $0.4 \mu m \sim 2 \mu m$  とすることが望ましい。

【0022】また、本発明の液晶表示装置において、配 向膜が有機物であり、絶縁膜が無機物であることが望ま しい。さらに、配向膜が有機物であり、絶縁膜が無機膜 と有機膜の2層構造であることが望ましい。

【0023】また、本発明の液晶表示装置において、配 向膜が有機物、絶縁膜が無機物であり、該有機物で構成

6 \*【0012】ここで、液晶層の比誘電率 ε は、次式の平 均の比誘電率を表す。

[0013]  $\varepsilon_i = (\varepsilon_i + 2\varepsilon_i) / 3$ 

ここで、 $\epsilon$ , は分子長軸方向の比誘電率であり、 $\epsilon$ , は分 子単軸方向の比誘電率である。

【0014】上記の比誘電率  $\epsilon$ , と比抵抗  $\rho$  の積  $\epsilon$ ,  $\rho$ が、 $1 \times 10^9 \, \Omega$ ・cm 未満であると、絶縁性を保持でき なくなり、また高い電圧保持率を維持できなくなる。上 限の値については後述する。

【0015】また、本発明者らは、横電界方式の液晶表 示装置において、残像をなくすには、配向膜及び/もし くは絶縁膜の表面抵抗の値が3.3×10<sup>11</sup>Ω/□以上 2.5×10<sup>18</sup> Ω/□以下であればよいことを見出し *\**-.

【0016】配向膜及び/もしくは絶縁膜の表面抵抗の 値が3.3×10<sup>11</sup>Ω/□ 未満であると、絶縁性を保持 できなくなり、また高い電圧保持率を維持できなくな る。上限の値については後述する。

【0017】また、本発明者らは、横電界方式の液晶表 20 示装置であって、液晶層,配向膜及び/もしくは絶縁膜 の比誘電率  $\epsilon$  、 と比抵抗  $\rho$  の積 (  $(\epsilon, \rho)_{1c}$  、  $(\epsilon$  $_{I}\rho$ )  $_{AB}$ 及び/もしくは( $_{EI}\rho$ ) $_{PAS}$ )を近似させるこ とを特徴とする液晶表示装置を発明した。

【0018】ここで、近似の定義としては、液晶層、配 向膜及び/もしくは絶縁膜の比誘電率  $\epsilon$ , と比抵抗  $\rho$  の 積  $((\epsilon, \rho)_{LC}, (\epsilon, \rho)_{AR}$ 及び/もしくは  $(\epsilon$ rρ) rAs)の最大値と最小値の比が1以上100以下で あることであり、また、別の定義としては、下記の (1)から(3)の関係が成立していることである。

しい。

[0019]

(1)(2)

【0024】また、配向膜及び絶縁膜が共に有機物で構 成されることも望ましく、配向膜及び絶縁膜が同一材料 であることも望ましい。さらに、配向膜の液晶層に接す る側の面が平坦であることが望ましい。

【0025】高画質のカラー表示を可能とするために は、カラーフィルターを基板のいずれか一方の上に、か つ、カラーフィルターと液晶層との間に絶縁膜が介在す ることが望ましい。また、カラーフィルター上の段差を 平坦化する機能を有する平坦化膜が有機物であり、平坦 化膜の上に無機物の膜が形成されていることが望まし い。さらに、カラーフィルターを有する基板に構成され る配向膜が無機物で構成される層を介していることが望 ましい。

[0026]

【作用】ここでは電界方向が基板にほぼ平行な方向に印 される層が該無機物で構成される層より厚いことが望ま 50 加される横電界方式の原理を最初に述べ、続いて本発明

-640-

の作用を述べる。

【0027】先ず初めに、電界方向に対する偏光板の偏光透過軸のなす角Φρ及び液晶界面近傍での液晶分子長軸(光学軸)方向のなす角Φιιの定義を示す(図2)。 偏光板及び液晶界面はそれぞれ上下に一対あるので必要に応じてΦρι, Φρι, Φιι, Φιιο と表記する。なお、図2は後述する図1の正面図に対応する。

【0028】図1(a),(b) は本発明の液晶パネル内 での液晶の動作を示す側断面を、図1 (c), (d) はそ の正面図を表す。図1ではアクティブ素子を省略してあ る。また、本発明ではストライプ状の電極を構成して複 数の画素を形成するが、ここでは一画素の部分を示し た。電圧無印加時のセル側断面を図1 (a) に、その時 の正面図を図1 (c) に示す。透明な一対の基板の内側 に線状の信号電極3, 画素電極4、及び共通電極5が形 成され、その上に絶縁膜7が付設され、さらに配向膜8 が塗布及び配向処理されている。基板間には液晶組成物 が挟持されている。棒状の液晶分子12は、電界無印加 時にはストライプ状電極の長手方向に対して若干の角 度、即ち45度<φιc<135度、又は、-45度<φ 1c < −135度をもつように配向されている。上下界面</p> 上での液晶分子配向方向はここでは平行、即ちφιει= Φι ε 2 を例に説明する。また、液晶組成物の誘電異方性 は正を想定している。

【0029】次に、電界9を印加すると図1(b),(d)に示したように電界方向に液晶分子がその向きを変える。偏光板2を偏光板透過軸11に配置することで電界印加によって光透過率を変えることが可能となる。このように、本発明によれば透明電極がなくともコントラストを与える表示が可能となる。液晶組成物の誘電率異方性は正を想定したが、負であっても構わない。その場合には初期配向状態をストライプ状電極の長手方向に垂直な方向から若干の角度  $| \phi_{LC} |$ (即ち、-45度く $| \phi_{LC} |$ (225度)を持つように配向させる。

【0030】なお、図1では共通電極が信号電極及び画素電極と異層である場合を示したが、共通電極は信号電極及び画素電極と同層であってもよい。図3には共通電極が画素電極と同層である際の画素構造の典型例を、図4及び図5には共通電極が画素電極と異層である場合の画素構造の典型例を示す。また、特に共通電極を具備しなくとも、走査電極に共通電極の機能をもたせることも可能である。しかしながら、以下に記述する本発明の概念は素子を構成する絶縁材料に関するものであり、種々の電極構造や薄膜トランジスタ構造に適用可能である。

【0031】同一図形や文字を30分間表示し続けた後、輝度が回復する時間が5分以内であるようにすることで残像のない高画質の液晶表示装置を得ることができる。残像は液晶層、配向膜又は絶縁膜内に、何らかの原因で分極が生じた場合に誘発される。したがって、具体 50

的には液晶層,配向膜及び/もしくは絶縁膜の比誘電率  $\varepsilon$ , と比抵抗 $\rho$ の積( $(\varepsilon$ ,  $\rho$ )  $\iota$ c,  $(\varepsilon$ ,  $\rho$ )  $\iota$ p 及び/も しくは  $(\varepsilon$ ,  $\rho$ )  $\iota$ As  $\rho$ S が、 $\rho$ S ×  $\rho$ S  $\rho$ S ×  $\rho$ S ×

8

できるため、残像が軽減される。

【0032】この場合の残像低減の原理のモデル図を図11(a)に示した。すなわち、画像内にある電荷が蓄積されてもその緩和速度が速く、電荷量が短い時間でなくなることによる。また、図11(b)のように蓄積される電荷量を小さくしてやることにより、緩和速度が速くなくとも残像を低減することができる。そこで、蓄積される電荷量を小さくするために、配向膜及び/もしくは絶縁膜の表面抵抗の値を2.5×10<sup>18</sup> Ω/□ 以下にすることによっても残像を改善することができる。さらに、液晶層、配向膜及び/もしくは絶縁膜の比誘電率 ε、と比抵抗ρの積、ε、ρを、ほぼ等しくすることによって残像をさらに低減することができる。

【0033】前述のように、残像は液晶層、配向膜又は 絶縁膜内に何らかの原因で分局が生じた場合に誘発され 20 る。また、配向膜に生じた分極は液晶層の二次的な分極 を生み出すなど、各層や膜内の分極は互いに干渉し合 う。例えば、液晶層の分極の緩和過程においても配向膜 の分極が残存していると、その分極は液晶層に影響を与 え液晶層の分極の緩和を妨げるように作用する。したが って、各層あるいは膜に生じた分極が互いに干渉しない ように緩和するためには、それぞれの緩和時間が等しく なければならない。この原理は電界が基板に対して平行 に印加される方式、つまり、横電界方式で特に顕著に成 立することを見出した。横電界方式では液晶層、絶縁膜 及び配向膜に相当する電気的等価回路が並列につながっ ている。したがって、例えば配向膜や絶縁膜の比誘電率  $\varepsilon$ , と比抵抗  $\rho$  の積、  $\varepsilon$ ,  $\rho$  が液晶層のそれより大きい と、配向膜や絶縁膜に残存している電圧が液晶層に余分 な電圧として印加され、結果として残像を誘発する。さ らに、抵抗Rが $\rho$ d/S( $\rho$ :比抵抗, d:電界方向の 長さ, S:電界に垂直な断面積)で表わされることを考 えると、横電界方式では電界を基板に対して垂直に印加 する方式に比べ、素子構造上非常に大きな抵抗を有して いる。すなわち、横電界方式では残留する直流成分が大 きいことを意味している。このような場合、残像を一層 低減するためには、さらに液晶層、配向膜及び/もしく は絶縁膜の比誘電率 ε ι と比抵抗 ρ の積 ( (ε  $r\rho$ ) LC,  $(E_r\rho)_{AP}$ 及び/もしくは  $(E_r\rho)_{PAS}$ ) が、8×10<sup>15</sup>Ω・cm以下にするとよい。このようにす れば、蓄積された電荷の緩和過程において、液晶層、配 向膜及び/もしくは絶縁膜が互いに干渉することなく短 い時間で緩和する。

【0034】これらは、横電界方式において単純マトリクス駆動方式、あるいはアクティブマトリクス駆動方式 に関わらず成立するものである。

【0035】一方、液晶を配向させる機能を有する膜 (配向膜) と電気的な絶縁と電極群を保護する機能を有 する膜(絶縁膜)の厚みを合わせて $0.5 \mu m$ 以上 $3 \mu$ m以下、望ましくは0.7 μm以上2.8 μm以下にする ことにより、各画素における配向膜と絶縁膜の抵抗成分 を小さくすることができる。

【0036】実際には、電極群を付設してある基板上の 段差を軽減するためにも、絶縁膜の厚さを 0.4 μm 以 上2μm以下に設定するのが好ましい。

【0037】前述したように、横電界方式においては、 液晶層と配向膜及び絶縁膜に相当する電気的等価回路が 並列につながっている。したがって、配向膜や絶縁膜に 残留した電圧はそのまま液晶層に印加されることにな る。残像は配向膜や絶縁膜に残留した電圧が液晶層に印 加されることに起因することを考慮すると、各画素にお ける配向膜と絶縁膜に相当する抵抗成分を小さくすれば 配向膜や絶縁膜に残留する電圧を低減でき、液晶層に印 加される余分な電圧もなくなる。配向膜及び絶縁膜の抵 抗成分を小さくするには、配向膜及び絶縁膜の膜厚を厚 くし、電界方向に垂直な断面積を大きくすればよい。

【0038】このような場合、絶縁膜を信頼性が高い無 機物で形成し、配向膜を有機物で形成するとよい。ま た、絶縁膜を無機膜と形成することが比較的容易な有機 膜の2層構造にすることもよい。図8に各層の誘電率の 大小によって液晶層内で電気力線が変化することを表す 模式図を示す。液晶層に比して配向膜や絶縁膜の誘電率 が小さいほど理想的な横電界が達成される。したがっ て、無機物の層を一般に誘電率の小さい有機物の層にで きるだけ置き換えることで基板に水平な電界成分を効率 良く利用することができる。さらには、絶縁膜を有機物 にすることでその効果は有効となる。また、絶縁膜と配 向膜を同一材料にすることはプロセス上の高効率化にも つながる。

【0039】液晶表示装置の画質を高めるためには、液 晶に接する配向膜表面を平坦化することも重要である。 これにより表面の段差をなくし、ラビングの効果を面内 で均一にすることで光漏れを抑えることができる。

【0040】横電界方式をカラー表示するには、カラー フィルターと液晶層の間に絶縁体のみが介在することが 必要である。導電体の存在によって横電界成分が破壊さ 40 れてしまうからである。

【0041】一般に、カラーフィルターの平坦化膜には エポキシ樹脂などの有機物が用いられており、その上に 透明電極が設けられている。しかしながら、横電界方式 では透明電極が前述のごとく必要ないため、平坦化膜が 直接配向膜と接することになる。この場合、配向膜の印 刷性にしばしば問題が生ずるため、平坦化膜の上層に窒 化シリコンなどの無機物層を設けると印刷性を高めるの に効果がある。

【0042】カラーフィルターは必ずしも電極群が存在 50

10

しない基板側に具備させる必要がなく、むしろ、アクテ ィブ素子や電極群が付設されている基板側に構成するこ とでアラインメントの精度を高めることができる。

[0043]

【実施例】本発明を実施例により具体的に説明する。

【0044】〔実施例1〕図3は本発明の単位画素にお ける各種電極の構造を示した第1の例である。研磨した ガラス基板上にA1よりなる走査電極13を形成し、前 記走査電極の表面はAIの陽極酸化膜であるアルミナ膜 で被覆した。走査電極を覆うようにゲート絶縁(ゲート SiN) 膜6とアモルファスシリコン(a-Si) 膜1 4を形成し、このa-Si膜上にn型a-Si膜、画素 電極4及び信号電極3を形成した。さらに、前記画素電 極及び信号電極と同層に共通電極5を付設した。画素電 極及び信号電極の構造としては図3に示すように、いず れもストライプ状の共通電極と平行で、走査電極と交差 するような構造とし、一方の基板上に薄膜トランジスタ 15及び金属電極群が形成された。これらによって、一 方の基板上の画素電極,共通電極間で電界9がかかり、 20 かつその方向が基板界面にほぼ平行となるようにした。 基板上の電極はいずれもアルミニウムからなるが、電気 抵抗の低い金属性のものであれば特に材料の制約はな く、クロム、銅等でもよい。

【0045】画素数は40(×3)×30(即ち、n= 120, m=30である。) で、画素ピッチは横方向 (即ちコモン電極間) は80 µm, 縦方向(即ちゲート 電極間) は 2 4 0  $\mu$  m である。コモン電極の幅は 1 2  $\mu$ mで隣接するコモン電極の間隙の68μmよりも狭く し、高い開口率を確保した。また薄膜トランジスタを有 する基板に相対向する基板上にストライプ状のR,G, B3色のカラーフィルターを備えた。カラーフィルター の上には表面を平坦化する透明樹脂を積層した。透明樹 脂の材料としてはエポキシ樹脂を用いた。更に、この透 明樹脂上にポリイミド系の配向膜を塗布した。パネルに は図7のように駆動LSIが接続され、TFT基板上に 走査信号回路20,映像信号回路21を接続し、電源及 びコントローラ22から走査信号電圧,映像信号電圧, タイミング信号を供給し、アクティブマトリクス駆動し た。

【0046】一方、上下界面近傍での液晶分子長軸方向 は互いにほぼ平行で、かつ印加電界方向とのなす角度を  $15 g (\phi_{LC1} = \phi_{LC2} = 15^{\circ}) とした (図2) 。 ギャ$ ップdは球形のポリマビーズを基板間に分散して挟持 し、液晶封入状態で6.5μmとした。2枚の偏光板 〔日東電工社製G1220DU〕でパネルを挟み、一方 の偏光板の偏光透過軸をラビング方向(界面近傍での液 晶分子長軸方向) にほぼ平行、即ちør1=15°とし、 他方をそれに直交、即ち or2=-75° とした。これに より、ノーマリクローズ特性を得た。

【0047】基板間にはトランス、トランス-4、4′

ージベンチルートランスー1, 1'ージシクロへキサンー4ーカルボニトリルを主成分とした誘電異方性 $\Delta$ εが 負のZLI-2806(メルク社製)を挟持した。液晶の比抵抗は $5.1\times10^{11}$   $\Omega$ cmであり、平均の比誘電率は6.5 であった。一方、絶縁膜には窒化シリコン(SiN)を用い、その比抵抗は $2.5\times10^{13}$   $\Omega$ cm であり、比誘電率は8 であった。また、配向膜は2, 2 ーピス [4 - (p-p = 2 -

12

用い、その比抵抗は $7.5\times10^{18}\,\Omega$ cm,比誘電率は2.9であった。したがって、液晶,絶縁膜及び配向膜のそれぞれの比抵抗 $\rho$ と比誘電率 $\epsilon$ ,の積 $\epsilon$ , $\rho$ は、 $1\times10^{9}\,\Omega$ ・cm以上 $8\times10^{16}\,\Omega$ ・cm以下であって、三者の中の最大値と最小値の比が1以上100以下であった。

【0048】表1に実施例1~12, 比較例1及び2の 積ε,ρ の値を示す。

[0049]

【表1】

表 1

実統例	(ε rp)LC Ω · cm	(ε rp)AF Ω·cm	(ε rp)PAS Ω·cm	log ( e rp)AF ( e rp)PAS	log (e rp)LC	$\log \frac{(\epsilon rp)LC}{(\epsilon rp)PAS}$
	sz · Cini	2 GII	<b>22</b> CIII	(819)170	(2.19/4.1	(0,0)
1	3.3X10 <sup>12</sup>	2.2X10 <sup>14</sup>	2.0X10 14	0	-1.8	-1.8
2	3.1X10 <sup>15</sup>	2.9X10 <sup>14</sup>	2.4X10 15	-0.9	1.0	0.1
3	6.1X10 <sup>12</sup>	7.8X10 <sup>13</sup>	5.0X10 <sup>14</sup>	-0.8	-1.1	-1.9
4	9.2X10 <sup>13</sup>	1.2X10 <sup>14</sup>	4.5X10 12	1.4	0.8	1.3
5 6 7	9.8X10 <sup>18</sup>	1.5X10 <sup>14</sup>	1.7X10 <sup>12</sup>	2.0	-0.2	1.8
8	1.5X10 <sup>19</sup>	1.0X10 <sup>14</sup>	1.0X10 14	0	-0.8	-0.8
9	6.1X10 <sup>14</sup>				1.0	1.0
10	3.1X10 <sup>12</sup>		<u> </u>		-1.4	-2.3
11	1.2X10 <sup>15</sup>	5.8X10 12	8.0X10 <sup>13</sup>	-1.1	2.3	1.2
12	1.2X10 <sup>14</sup>	8.0X10 15	8.0X10 15	-2.0	0.2	-1.8

比較例	Ω·cm	(ε rp)AF Ω·cm	(ε rp)PAS Ω•cm	log ( c m)AF	log ( e rp)LC	log (ε rp)LC (ε rp)PAS
1		5.8X10 12	4.8X10 14	-1.1	2.3	1.2
2	3.8X10 <sup>13</sup>	1.6X10 <sup>13</sup>	1.6X10 16	-2.3	0.6	-1.7

【0050】残像は目視で5段階評価した。同一図形パターンを30分間表示し続け、その後消去した際に輝度が回復する時間によって分類した。5は輝度が回復するのに5分を越えるもの、4は1以上5分以内、3は30秒以上1分以内、2は30秒以内であるが残像が起こっていると感じられるもの、1は残像が全く起こらなかったものというように分類評価した。本実施例1の残像の評価段階は1であり、残像が全く発生しなかった。

【0051】本発明は素子を構成する絶縁材料の比誘電率と比抵抗に関するものであり、種々の電極構造やTF T構造に適用可能である。

【0052】〔実施例2〕図4は本発明の単位画素における各種電極の構造を示した第2の例である。研磨した 50

ガラス基板上にA1よりなる走査電極13及び共通電極5を形成し、前記走査電極の表面はA1の陽極酸化膜であるアルミナ膜で被覆した。走査電極及び共通電極を覆うようにゲート絶縁(ゲートSiN)膜6を形成した。次に、アモルファスシリコン(a-Si)膜14とこのa-Si膜上にn型a-Si膜を形成した。さらに、画素電極4及び信号電極3を付設した。従って、画素電極と共通電極は異層である。画素電極の構造としては図4に示すように、Hの字状の構造にし、共通電極は十字状の形を形成し、それぞれの電極の一部が容量素子として機能するような構造にした。これらによって、一方の基板上の画素電極,共通電極間で電界がかかり、かつその方向が基板界面にほぼ平行となるようにした。基板上の

【0058】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は1であり、残像 が全く発生しなかった。

14

電極はいずれもアルミニウムからなるが、電気抵抗の低 い金属性のものであれば特に材料の制約はなく、クロ ム, 銅等でもよい。画素数は320×160で、画素ピッチは 横方向 (即ち信号電極間) は100μm, 縦方向(即ち 走査電極間)は300μmである。パネルには図7のよ うに駆動LSIが接続され、TFT基板上に走査信号回 路20、映像信号回路21を接続し、電源及びコントロ ーラ22から走査信号電圧、映像信号電圧、タイミング 信号を供給し、アクティブマトリクス駆動した。

【0059】〔実施例4〕図5は本発明の単位画素にお ける各種電極の構造を示した第3の例である。薄膜トラ ンジスタ15は画素電極4,信号電極3,走査電極13 及びアモルファスシリコン膜14から構成される。共通 電極5は走査電極13と同層とし、同一の金属をパター ン化した。また、画素電極4と信号電極3も同一金属層 でパターン化して構成した。容量素子は、2本の共通電 極5の間を結合する領域において画素電極4と共通電極 5でゲート絶縁 (ゲートSiN) 膜6を挟む構造として 形成した。画素電極4は正面断面図(図5,A-A′) において、2本の共通電極5の間に配置されている。画 素ピッチは横方向(すなわち信号電極間)は69μm、 縦方向(すなわち走査電極間)は207μmである。電極 幅はそれぞれ  $10\mu$  mである。一方、開口率向上のため に1画素単位で独立に形成した画素電極4、及び共通電 極5の信号電極3の長手方向に伸びた部分の幅は若干狭 くし、それぞれ $5\mu$ m、 $8\mu$ mとした。できるだけ高い 開口率を実現するために絶縁膜を介して共通電極5と信 号電極3を若干(1 µm)重ね、走査電極方向のみ遮光 板16で遮光した。このようにして、共通電極5と画素 電極4とのギャップが20 mm、開口部の長手方向の長 さが157 µmとなり、44.0% の高開口率が得られ た。画素数は320本の信号電極と160本の走査電極 とにより320×160個とした。パネルには図7のよ うに駆動LSIが接続され、TFT基板上に走査信号回 路20、映像信号回路21を接続し、電源及びコントロ ーラ22から走査信号電圧、映像信号電圧、タイミング 信号を供給し、アクティブマトリクス駆動した。

【0053】一方、上下界面近傍での液晶分子長軸方向 10 は互いにほぼ平行で、かつ印加電界方向とのなす角度を 105度 ( $\phi_{LC1} = \phi_{LC2} = 105$ °) とした (図2)。 ギャップdは球形のポリマビーズを基板間に分散して挟 持し、液晶封入状態で4.2μmとした。2枚の偏光板 〔日東電工社製G1220DU〕でパネルを挟み、一方 の偏光板の偏光透過軸をラビング方向(界面近傍での液 晶分子長軸方向) にほぼ平行、即ちゅ p1 = 105° と し、他方をそれに直交、即ち 012=15°とした。これ により、ノーマリクローズ特性を得た。

> 【0060】絶縁膜には有機物であるエポキシ樹脂の1 層構造とし、この絶縁膜上に配向膜としてRN-718 (日産化学製)を塗布した。このとき、絶縁膜の比抵抗 は1.5×10<sup>12</sup> Ωcmであり、比誘電率は3.0であっ た。配向膜の比抵抗は4.0×10<sup>13</sup> Ω cmであり、比誘 電率は3.1であった。また、液晶の比抵抗は1.5×1  $0^{13}\Omega$ cm であり、比誘電率は 6.1 であった。したがっ て、液晶, 絶縁膜及び配向膜のそれぞれの比抵抗ρと比 誘電率 ε, の積 ε, ρは、1×10° Ω·cm 以上8×10 15 Ω・cm以下であって、三者の中の最大値と最小値の比 が1以上100以下であった。

【0054】基板間には末端に3つのフルオロ基を有す 20 る化合物を主成分とした誘電異方性Δεが正の液晶を挟 持した。液晶の比抵抗は5.0×10<sup>14</sup> Ωcm であり、平 均の比誘電率は6.1 であった。一方、絶縁膜には窒化 シリコン (SIN) を用い、その比抵抗は3.0×10 14 Ωcm であり、比誘電率は8であった。また、配向膜 は2, 2-ピス [4-(p-アミノフェノキシ) フェニ ルプロパン]とピロメリット酸二無水物からなるポリイ ミド配向膜を用い、その比抵抗は1.0×10<sup>14</sup>Ωcm, 比誘電率は2.9 であった。したがって、液晶、絶縁膜 及び配向膜のそれぞれの比抵抗  $\rho$  と比誘電率  $\epsilon$ , の積  $\epsilon$ , ρは、1×10°Ω·cm 以上8×10<sup>15</sup>Ω·cm以下であ って、三者の中の最大値と最小値の比が1以上100以 下であった。

> 【0061】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は1であり、残像 が全く発生しなかった。

【0055】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は1であり、残像 が全く発生しなかった。

【0062】 〔実施例5〕本実施例の構成は下記の要件

【0056】〔実施例3〕本実施例の構成は下記の要件 を除けば、実施例2と同一である。

を除けば、実施例4と同一である。

【0057】絶縁膜には無機物である窒化シリコン(S iN)と有機物であるエポキシ樹脂の2層構造とし、こ 40 の2層の絶縁膜上に配向膜としてRN-718(日産化 学製)を塗布した。このとき、絶縁膜の比抵抗は9.1× 10<sup>13</sup>Ωcm であり、比誘電率は5.5 であった。配向 膜の比抵抗は2.5×10<sup>13</sup> Ωcm であり、比誘電率は 3.1であった。また、液晶の比抵抗は $1.0 \times 10^{12}$   $\Omega$ cmであり、比誘電率は6.1 であった。したがって、液 晶, 絶縁膜及び配向膜のそれぞれの比抵抗ρと比誘電率 ε,の積ε,ρは、1×10°Ω·cm 以上8×10<sup>15</sup>Ω· cm以下であって、三者の中の最大値と最小値の比が1以 上100以下であった。

【0063】絶縁膜中にカラーフィルターを形成した。 まず、窒化シリコン(SIN)を形成後、カラーフィル 50 ターを印刷によって付設した。さらに、表面の平坦化の ためにエポキシ樹脂を塗布した。そして、配向膜として RN-718 (日産化学製)を塗布,形成した。

【0064】このとき、絶縁層の比抵抗は4.4×10 11 Ωcmであり、比誘電率は3.9であった。配向膜の比 抵抗は4.9×10<sup>13</sup> Ωcmであり、比誘電率は3.1であ った。また、液晶の比抵抗は1.6×10<sup>13</sup>Ωcmであ り、比誘電率は6.1であった。したがって、液晶、絶 縁膜及び配向膜のそれぞれの比抵抗 $\rho$ と比誘電率 $\epsilon$ ,の 積ειρは、1×10°Ω·cm以上8×10<sup>15</sup>Ω·cm以下 であって、三者の中の最大値と最小値の比が1以上10 10 0以下であった。

【0065】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は1であり、残像 が全く発生しなかった。

【0066】〔実施例6〕本実施例の構成は下記の要件 を除けば、実施例5と同一である。

【0067】配向膜の液晶に接する面の平坦性を高める ため、配向膜の膜厚を実施例5で実施した膜厚(100 0Å)の5倍、つまり、5000Åに設定した。これに ビング処理を均一に行うことができた。結果的に、段差 部での光漏れをなくすことができた。

【0068】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は1であり、残像 が全く発生せず、さらにコントラストも実施例5に比べ て大きくなった。

【0069】〔実施例7〕本実施例の構成は下記の要件 を除けば、実施例6と同一である。

【0070】エポキシ樹脂層の上へのポリイミド配向膜 の印刷性は必ずしも良好なものではない。そこで、カラ ーフィルターの平坦化と絶縁膜を兼ねているエポキシ樹 脂上に無機物である窒化シリコン(SiN)を形成し た。このことにより、配向膜の印刷性が向上した。

【0071】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は1であり、残像 が全く発生せず、さらにコントラストも実施例5に比べ て大きくなり、配向膜の印刷性が改善され歩留まりが向 上した。

【0072】〔実施例8〕本実施例の構成は下記の要件 を除けば、実施例4と同一である。

【0073】絶縁膜と配向膜を同一材料にした。したが って、膜形成の工程が減り、スループットが向上した。 絶縁膜と配向膜を兼ねる膜には2,2-ピス [4-(p ーアミノフェノキシ)フェニルプロパン]とピロメリッ ト酸二無水物からなるポリイミドを1.5μm形成し た。

【0074】絶縁膜と配向膜を兼ねるポリイミド膜の比 抵抗は3.5×10<sup>13</sup>Ωcm であり、比誘電率は2.9で あった。また、液晶の比抵抗は2.5×10<sup>12</sup> Ωcmであ り、比誘電率は 6.1 であった。したがって、液晶、絶 *50*  16

緑膜及び配向膜のそれぞれの比抵抗 $\rho$ と比誘電率 $\epsilon$ ,の 積ε,ρは、1×10°Ω·cm以上8×10<sup>15</sup>Ω·cm 以 下であって、三者の中の最大値と最小値の比が1以上1 00以下であった。

【0075】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は1であり、残像 が全く発生しなかった。

【0076】〔実施例9〕図6は本発明の単位画素にお ける各種電極の構造を示した第4の例である。 本実施例 では各画素に薄膜トランジスタを付設しなかった。走査 電極13と信号電極3は異層とし、それぞれの電極は走 査回路ドライバと信号回路ドライバに接続し、単純時分 割マトリクス駆動した。

【0077】上下界面近傍での液晶分子長軸方向は互い にほぼ平行で、かつ印加電界方向とのなす角度を105 度 ( $\phi_{LC1} = \phi_{LC2} = 105^{\circ}$ ) とした (図2)。ギャッ プdは球形のポリマビーズを基板間に分散して挟持し、 液晶封入状態で4.2μm とした。2枚の偏光板〔日東 電工社製G1220DU」でパネルを挟み、一方の偏光 より、表面の平坦性が増し、段差が軽減されたため、ラ 20 板の偏光透過軸を界面近傍での液晶分子長軸方向にほぼ 平行、即ち φε1 = 105° とし、他方をそれに直交、即 **ちφε2=15°とした。これにより、ノーマリクローズ** 特性を得た。

> 【0078】ところで、本実施例では末端に3つのフル オロ基を有するトリフッ素化合物を主成分とする、比抵 抗が1.0×10¼ Ωcm である液晶を用いた。また、そ の液晶の平均の比誘電率は6.1であった。一方、絶縁 膜には窒化シリコン (SiN)を用い、その比抵抗は1. 0×10<sup>12</sup> Ωcm 、比誘電率は8であった。また、配向 膜は2, 2-ビス [4-(p-アミノフェノキシ)フェ ニルプロパン〕とピロメリット酸二無水物からなるポリ イミド配向膜を用い、その比抵抗は2.2×10<sup>13</sup>Ωcm、 比誘電率は2.9 であった。したがって、液晶、絶縁膜 及び配向膜のそれぞれの比抵抗  $\rho$  と比誘電率  $\epsilon$ , の積  $\epsilon$ , ρは、1×10°Ω・cm 以上8×10<sup>15</sup>Ω・cm以下であ って、三者の中の最大値と最小値の比が1以上100以 下であった。

【0079】このようにして得られた液晶表示装置の残 像の評価段階は1であり、残像が全く発生しなかった。

【0080】〔実施例10〕本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例1と同一である。

【0081】液晶の比抵抗は2.0×10<sup>11</sup>Ωcmであ り、平均の比誘電率は6.5であった。絶縁膜は窒化シ リコン (SIN) を用い、その比抵抗は3.0×10<sup>13</sup> Ωcm であり、比誘電率は8.0 であった。また、配向 膜には2,2-ビス[4-(p-アミノフェノキシ)フ ェニルプロパン] とピロメリット酸二無水物からなるポ リイミド配向膜を用い、その比抵抗は1.0×10<sup>13</sup> Ωc 11、比誘電率は2.9であった。したがって、液晶層、絶 縁膜及び配向膜のそれぞれの比抵抗 $\rho$ と比誘電率 $\epsilon$ ,の

積  $\varepsilon$ ,  $\rho$  は、 $1 \times 10^{\circ}$   $\Omega$ ・cm以上 $8 \times 10^{15}$   $\Omega$ ・cm以下 であった。

【0082】このようにして得られたアクティブマトリクス型液晶表示装置の残像の評価段階は3であり、残像の時間は5分以内であった。

【0083】〔実施例11〕本実施例の構成は下記の要件を除けば、実施例2と同一である。

【0084】液晶の比抵抗は $2.0\times10^{14}$   $\Omega$ cmであり、平均の比誘電率は6.1 であった。絶縁膜には二酸化珪素( $SiO_2$ )を用い、その比抵抗は $1.0\times10^{13}$   $\Omega$ cmであり、比誘電率は8.0 であった。また、配向膜は2,2-ピス [4-(p-アミノフェノキシ) フェニルプロパン] とピロメリット酸二無水物からなるポリイミド配向膜を用い、その比抵抗は $2.0\times10^{12}$   $\Omega$ cm,比誘電率は2.9 であった。したがって、液晶層,絶縁膜及び配向膜のそれぞれの比抵抗 $\rho$  と比誘電率 $\epsilon$ ,の積 $\epsilon$ , $\rho$ は、 $1\times10^9$   $\Omega$  · cm以上 $8\times10^{15}$   $\Omega$  · cm以下であった。

【0085】このようにして得られたアクティブマトリ 配向膜を使用し、その膜厚を $0.3\mu$ mとした。したがクス型液晶表示装置の残像の評価段階は4であり、残像 20 って、絶縁膜と配向膜の膜厚は合わせて $1.5\mu$ mとなの時間は5分以内であった。

【0086】 〔実施例12〕 本実施例の構成は下記の要件を除けば、実施例2と同一である。

【0088】このようにして得られたアクティブマトリクス型液晶表示装置の残像の評価段階は4であり、残像の時間は5分以内であった。

【0089】〔実施例13〕実施例4と同様な電極構造とし、アクティブマトリクス駆動した。

【0090】本実施例では絶縁膜として窒化シリコン 全く (SiN)を使用し、絶縁膜の膜厚を $0.4\mu$ m とし と酌た。さらに、配向膜として4,4' ージアミノジフェニ 40 た。ルエーテルとピロメリット酸二無水物からなるポリイミ ド系配向膜を用いた。この配向膜の膜厚は、 $0.1\mu$ m 件を とした。したがって、絶縁膜と配向膜の膜厚は合わせて  $0.5\mu$ m となった。 リニ

【0091】両基板間には誘電率異方性 $\Delta \epsilon$ が正でその値が4.5であり、複屈折 $\Delta n$ が0.072(589nm, 20°C)のネマチック液晶組成物を挟んだ。一方、上下界面上の液晶分子長軸方向は互いにほぼ平行で、かつ印加電界方向とのなす角度を95°C)とした。ギャップdは球形のポリマビーズを基 50

18

板間に分散して挟持し、液晶封入状態で $4.5 \mu m$  とした。よって $\Delta n \cdot d$ は $0.324 \mu m$  である。2枚の偏光板 (日東電工社製G 1220 DU) でパネルを挟み、一方の偏光板の偏光透過軸を界面上の液晶分子長軸方向にほぼ平行、即ち $\phi_{11}=95$ ° とし、他方をそれに直交、即ち $\phi_{12}=5$ ° とした。これにより、ノーマリクローズ特性を得た。

【0092】このようにして得られたアクティブマトリクス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が10全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保していた

【0093】〔実施例14〕本実施例の構成は下記を除けば、実施例13と同じである。

【0095】このようにして得られたアクティブマトリクス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保していた。

【0096】〔実施例15〕本実施例の構成は下記の要件を除けば、実施例13と同一である。

【0097】本実施例では絶縁膜を無機物である窒化シリコン (SiN) と有機物であるエポキシ樹脂の 2 層構造とした。窒化シリコン層を $1.0\,\mu$ m , エポキシ樹脂層を $0.6\,\mu$ m とした。さらに、配向膜としてRN-718 (日産化学製)を使用し、その膜厚を $0.2\,\mu$ m とした。したがって、絶縁膜と配向膜の膜厚は合わせて $1.8\,\mu$ m となった。

【0098】このようにして得られたアクティブマトリクス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保していた

【0099】〔実施例16〕本実施例の構成は下記の要件を除けば、実施例13と同一である。

【0100】本実施例では絶縁膜を無機物である窒化シリコン (SIN) と有機物であるエポキシ樹脂の2層構造とした。窒化シリコン層を $0.3\,\mu\mathrm{m}$  , エポキシ樹脂層を $1.5\,\mu\mathrm{m}$  とした。さらに、配向膜として $\mathrm{RN}-7$ 18 (日産化学製)を使用し、その膜厚を $0.2\,\mu\mathrm{m}$  とした。したがって、絶縁膜と配向膜の膜厚は合わせて $2.0\,\mu\mathrm{m}$ となった。

【0101】このようにして得られたアクティブマトリ

クス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が 全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜 と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保してい /

【0102】〔実施例17〕本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例13と同一である。

【0103】本実施例では絶縁膜として二酸化珪素(S i O<sub>2</sub>) を使用し、絶縁膜の膜厚を 0.2 μm とした。 さらに、配向膜として4,4′-ジアミノジフェニルエ ーテルとピロメリット酸二無水物からなるポリイミド系 10 配向膜を使用し、その膜厚を2.0μmとした。したが って、絶縁膜と配向膜の膜厚は合わせて2.2 µmとな った。

【0104】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が 全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜 と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保してい

【0105】〔実施例18〕本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例13と同一である。

【0106】本実施例では絶縁膜としてエポキシ樹脂を 使用し、絶縁膜の膜厚を1.8μmとした。さらに、配 向膜として2, 2-ピス [4-(p-アミノフェノキ シ)フェニルプロパン]とピロメリット酸二無水物から なるポイミド系配向膜を使用し、その膜厚を 0.5 μm とした。したがって、絶縁膜と配向膜の膜厚は合わせて 2.3 μm とした。

【0107】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が 全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜 30 厚を0.1μm にした。 と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保してい た。

【0108】〔実施例19〕本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例13と同一である。

【0109】本実施例では絶縁膜と配向膜に用いる物質 を同一にした。つまり、絶縁膜と配向膜の機能を合わせ 持つ2,2-ピス[4-(p-アミノフェノキシ)フェ ニルプロパン]とピロメリット酸二無水物からなるポイ ミド系配向膜を塗布し、その膜厚を2.8μm とした。

クス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が 全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜 と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保してい

【0111】〔実施例20〕本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例13と同一である。

【0112】絶縁膜中にカラーフィルターを形成した。 まず、窒化シリコン(SiN)を形成後、カラーフィル ターを印刷によって付設した。さらに、表面の平坦化の ためにエポキシ樹脂を塗布した。そして、配向膜として 50 た。さらに、配向膜としてRN-718を用いた。この

20

RN-718 (日産化学製)を塗布, 形成した。

[0113] このとき、窒化シリコン層は $0.3 \mu m$ , エポキシ樹脂層は1.5 μmとした。また、配向膜は0. 1μm 塗布した。

【0114】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり、残像が 全く発生しなかった。一方、図10に示すように絶縁膜 と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保してい

【0115】 (実施例21) 本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例20と同一である。

【0116】配向膜の液晶に接する面の平坦性を高める ため、エポキシ樹脂層を2.0μm,配向膜RN-718 の膜厚を $0.7 \mu m$  にした。これにより、表面の平坦性 が増し、段差が軽減されたため、ラビング処理を均一に 行うことができた。結果的に段差部での光漏れをなくす ことができた。

【0117】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり残像が全 20 く発生せず、さらにコントラストも実施例20に比べて 大きくなった。

【0118】〔実施例22〕本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例20と同一である。

【0119】エポキシ樹脂層の上へのポリイミド配向膜 の印刷性は必ずしも良好なものではない。そこで、カラ ーフィルターの平坦化と絶縁膜を兼ねている1.5μm のエポキシ樹脂上に無機物である窒化シリコン(Si 印刷性が向上した。このとき、配向膜RN-718の膜

【0120】 このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像は評価段階1であり残像が全 く発生せず、コントラストも実施例20に比べて大きく なり、さらに配向膜の印刷性が改善され歩留まりが向上 した。

【0121】〔実施例23〕実施例9と同様な電極構造 をし、単純時分割マトリクス駆動し、ノーマリクローズ 特性を得た。

【0122】絶縁膜として窒化シリコン (S1N) を膜 【0 1 1 0】 このようにして得られたアクティブマトリ 40  $\mathbb{P}$  0 0  $\mathbb{P}$  0  $\mathbb{P}$  0  $\mathbb{P}$   $\mathbb{$ 産化学製)を膜厚0.9 µm 形成した。

> 【0123】このようにして得られた液晶表示装置の残 像は評価段階1であり、残像が全く発生しなかった。-方、図10に示すように絶縁膜と配向膜の透明性は90 %以上の透過率を確保していた。

> 【0124】〔実施例24〕本実施例の構成は下記の要 件を除けば、実施例10と同一である。

【0125】本比較例では絶縁膜として窒化シリコン (SiN) を使用し、絶縁膜の膜厚を0.1 μm とし

配向膜の膜厚は、 $0.1 \mu m$ とした。したがって、絶縁 膜と配向膜の膜厚は合わせて 0.2 μmとなった。

【0126】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像は評価段階3であって、残像 時間は5分以内であった。一方、図10に示すように絶 縁膜と配向膜の透明性は90%以上の透過率を確保して いた。

【0127】本発明に用いる絶縁膜や配向膜の有機膜は 実施例に述べた有機高分子に限らず、ポリイミド、エポ ン, ポリビニールアルコール, ポリアミド, シリコー ン,アクリラート,オレフィン-スルホン系高分子な ど、非感光性、感光性に関わらず使用することができ る。さらに、有機髙分子中に例えばァーアミノプロピル トリエトキシシラン、δ-アミノプロピルメチルジエト キシシラン, N-β (アミノエチル)  $\gamma$ -アミノプロピ **ルトリメトキシシランなどのアミノ系シランカップリン** グ剤、エポキシ系シランカップリング剤、チタネートカ ップリング剤、アルミニウムアルコレート、アルミニウ ムキレート、ジルコニウムキレートなどの表面処理剤を 20 装置における液晶の動作を示す図。 混合もしくは反応することもできる。ただし、これらに 限定されるものではない。

【0128】また、無機膜も窒化シリコン、酸化シリコ ンなどに限らず、窒化ゲルマニウム、酸化ゲルマニウ ム、窒化アルミニウム、酸化アルミニウムなども使用す ることができる。ただし、これらに限定されるものでは

【0129】〔比較例1〕本比較例の構成は下記の要件 を除けば、実施例2と同一である。

【0130】液晶の比抵抗は2.0×10<sup>14</sup>Ωcmであ 30 り、平均の比誘電率は6.1であった。絶縁膜は窒化シ リコン (SiN) を用い、その比抵抗は6×10<sup>15</sup> Ωcm であり、比誘電率は8であった。また、配向膜は2,2 -ピス [4-(p-アミノフェノキシ) フェニルプロパ ン] とピロメリット酸二無水物からなるポリイミド配向 膜を用い、その比抵抗は2.0×10<sup>12</sup>Ωcm,比誘電率 は2.9であった。したがって、絶縁膜の比抵抗ρと比 誘電率 ε,の積 ε,ρは、8.0×10<sup>16</sup> Ωcm よりも大き くなった。

【0131】このようにして得られたアクティプマトリ *40* の関係を表した図。 クス型液晶表示装置の残像の評価段階は5であった。

【0132】〔比較例2〕本比較例の構成は下記の要件 を除けば、実施例2と同一である。

【0133】液晶の比抵抗は6.3×10<sup>12</sup>Ωcmであ り、平均の比誘電率は6.1であった。絶縁膜は窒化シ リコン (SiN) を用い、その比抵抗は2×10<sup>15</sup> Ωcm であり、比誘電率は8であった。また、配向膜は2,2 -ビス [4-(p-アミノフェノキシ) フェニルプロパ ン]とピロメリット酸二無水物からなるポリイミド配向 膜を用い、その比抵抗は $5.5 imes1.0^{12}\,\Omega$ cm,比誘電率 50 ファスシリコン膜、 $15\cdots$ 薄膜トランジスタ、 $16\cdots$ 遮

は2.9であった。したがって、絶縁膜の比抵抗ρと比 誘電率 ε, の積 ε, ρは、8.0×10<sup>15</sup> Ωcm よりも大き

【0134】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像の評価段階は5であった。

【0135】 〔比較例3〕本比較例の構成は下記の要件 を除けば、実施例10と同一である。

【0136】本比較例では絶縁膜として窒化シリコン (SiN)を使用し、絶縁膜の膜厚を0.1μm とし キシ系高分子などのほかに、ポリエステル,ポリウレタ 10 た。さらに、配向膜としてRN-718を用いた。この 配向膜の膜厚は、0.1μmとした。したがって、絶縁 膜と配向膜の膜厚は合わせて0.2μmとなった。

> 【0137】このようにして得られたアクティブマトリ クス型液晶表示装置の残像は評価段階5であった。

[0138]

【発明の効果】本発明によれば、残像の少ない横電界方 式の液晶表示装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の基板に水平な電界を印加する液晶表示

【図2】本発明の液晶表示装置において、電界方向に対 する界面上の分子長軸配向方向及び偏光板透過軸のなす 角を示す図。

【図3】単位画素の平面図及び断面図(第1の例)。

【図4】単位画素の平面図及び断面図(第2の例)。

【図5】単位画素の平面図及び断面図(第3の例)。

【図6】単位画素の平面図及び断面図(第4の例)。

【図7】本発明の液晶表示装置におけるシステム構成を 示す図。

【図8】 電気力線の屈折の法則の模式図及び各層の相対 的誘電率と層の厚みにより異なる横電界強度の違いを表 す図。

【図9】 (a) 液晶層,絶縁膜及び配向膜の比抵抗 p と 比誘電率  $\epsilon$ , の積  $\epsilon$ ,  $\rho$  の最大値と残像特性の関係を示す

(b) 液晶層, 絶縁膜及び配向膜の比抵抗ρと比誘電率  $\epsilon$ ,の積  $\epsilon$ , $\rho$ の最大値と最小値の比と残像特性の関係を

【図10】(a)絶縁膜と配向膜の膜厚の和と残像評価

(b) 絶縁膜と配向膜の膜厚の和と膜の透過率の関係を 表した図。

【図11】電荷の充電過程及び放電過程と残像特性の関 係を表した図。

【符号の説明】

1…基板、2…偏光板、3…信号電極、4…画素電極、 5…共通電極、6…ゲート絶縁膜、7…絶縁膜、8…配 向膜、9…電界、10…ラビング方向、11…偏光板透 過軸、12…液晶分子、13…走査電極、14…アモル

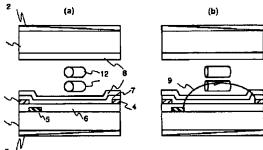
光板、17…前段走査電極の突起部、20…走査信号回路、21…映像信号回路、22…電源及びコントロー

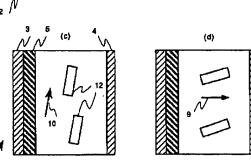
24 ラ、23…共通電極駆動用回路、24…アクティブマト リクス型液晶表示素子。

[図2]

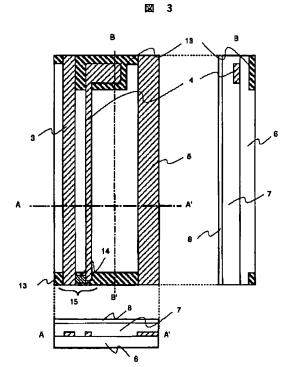
图 1

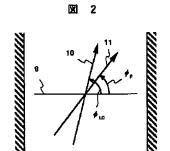
【図1】

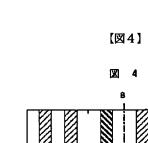


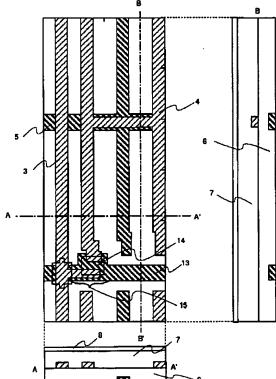


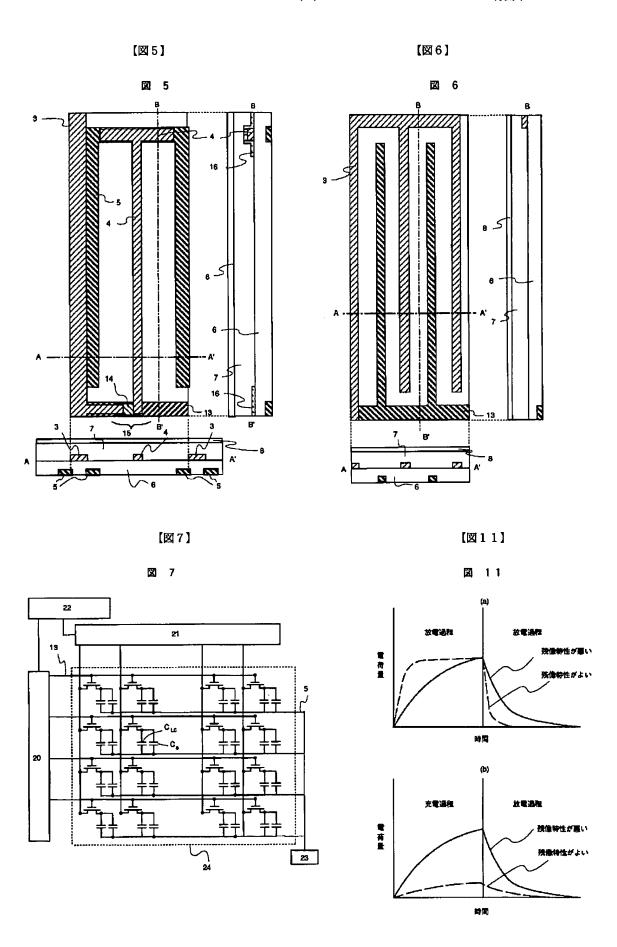






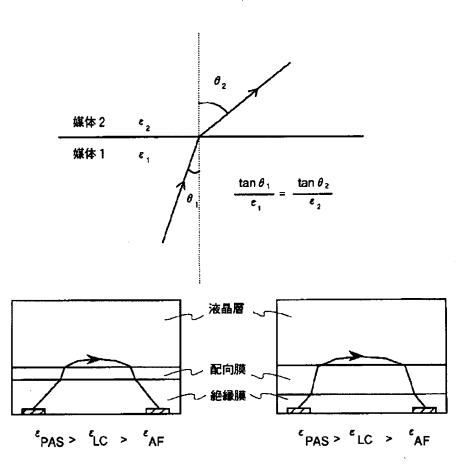






【図8】

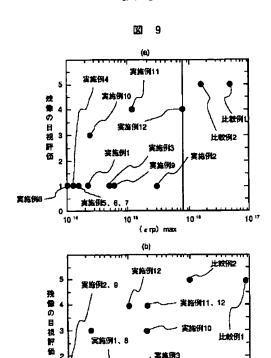
# 図 8



比較例1

10000





100 1000 (enp) max (enp) min

0 L 10

## 【図10】

